

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成25年12月26日(2013.12.26)

【公開番号】特開2012-141348(P2012-141348A)

【公開日】平成24年7月26日(2012.7.26)

【年通号数】公開・登録公報2012-029

【出願番号】特願2010-292056(P2010-292056)

【国際特許分類】

G 02 B 26/00 (2006.01)

G 01 J 3/26 (2006.01)

G 01 J 3/46 (2006.01)

【F I】

G 02 B 26/00

G 01 J 3/26

G 01 J 3/46 Z

【手続補正書】

【提出日】平成25年11月7日(2013.11.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1基板と、

前記第1基板と対向して位置する第2基板と、

前記第1基板の前記第2基板に対向する面に設けられた第1反射膜と、

前記第2基板の前記第1基板に対向する面に設けられ、前記第1反射膜と所定の隙間をもって位置する第2反射膜と、

前記第1基板に前記第1反射膜から離れて設けられた第1電極と、

前記第2基板に前記第2反射膜から離れて設けられた第2電極と、を備え、

前記第1反射膜に対して垂直方向で、前記第1電極と前記第2電極との距離は部分的に異なる距離に設定され、前記第1電極の第1の部分と前記第2電極との距離は前記所定の隙間よりも大きく、前記第1電極の第2の部分と前記第2電極との距離は前記所定の隙間よりも小さい

ことを特徴とする波長可変干渉フィルター。

【請求項2】

請求項1に記載の波長可変干渉フィルターにおいて、

前記第2反射膜と前記第2電極は、前記第2基板の同一平面に設けられ、

前記第1電極の前記第1の部分は、前記第1反射膜の垂直方向に、前記第1反射膜の表面とオーバーラップして前記第2電極に近づく位置にある

ことを特徴とする波長可変干渉フィルター。

【請求項3】

請求項1又は2に記載の波長可変干渉フィルターにおいて、

前記第1電極は前記第1反射膜の外側に環状に位置し、

前記第2電極は前記第2反射膜の外側に環状に位置している

ことを特徴とする波長可変干渉フィルター。

【請求項4】

請求項 1 から請求項 3 のいずれか一項に記載の波長可変干渉フィルターにおいて、前記第 1 電極の前記第 2 の部分は、前記第 1 電極の前記第 1 の部分よりも前記第 1 反射膜から遠くに位置することを特徴とする波長可変干渉フィルター。

【請求項 5】

請求項 1 から請求項 3 のいずれか一項に記載の波長可変干渉フィルターにおいて、前記第 1 電極の前記第 2 の部分は、前記第 1 電極の前記第 1 の部分よりも前記第 1 反射膜の近くに位置することを特徴とする波長可変干渉フィルター。

【請求項 6】

請求項 5 に記載の波長可変干渉フィルターにおいて、前記第 2 反射膜は前記第 1 反射膜よりも大きく設定され、前記第 2 反射膜と前記第 1 電極の前記第 2 の部分とが当接する状態において、前記第 1 反射膜と前記第 2 反射膜とは離隔していることを特徴とする波長可変干渉フィルター。

【請求項 7】

請求項 1 から請求項 6 のいずれかに記載の波長可変干渉フィルターと、前記波長可変干渉フィルターを透過した検査対象光を受光する受光手段と、を備えることを特徴とする光モジュール。

【請求項 8】

請求項 7 に記載の光モジュールと、前記光モジュールの前記受光手段により受光された光に基づいて、前記検査対象光の光特性を分析する分析処理部と、を備えることを特徴とする光分析装置。